

22-3 東北大学金属材料研究所材料分析研究コア分析電顕室設備等使用内規

制定 平成28年4月21日

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学金属材料研究所（以下「本所」という。）材料分析研究コア（以下「分析コア」という。）の管理する電子顕微鏡、附帯する研究設備及び機器（以下「設備等」という。）の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設備等)

第2条 使用の対象となる設備等は、本所材料分析研究コア長（以下「コア長」という。）が定める別表に掲げる設備等とする。

(使用者の資格)

第3条 設備等を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

- 一 東北大学の職員、大学院学生、学部学生及び研究生
- 二 東北大学の職員と研究上の協力関係を有する他の大学・研究機関等の研究者及び技術者のうち、東北大学の職員から紹介のあった者
- 三 東北大学ナノテク融合技術支援センターにおいて公開課題もしくは非公開課題として課題採択された者
- 四 その他コア長が特に認めた者

(使用の申請及び承認)

第4条 設備等の使用を希望する者は、部門等の責任者（以下「使用責任者」という。）が、所定の様式によりコア長に申請し、その許可を受けなければならない。

- 2 前項の様式は別に定める。
- 3 コア長は、前項の申請を受理した場合において、当該申請が分析コアの設置目的に対し適当と認めるときは、これを許可するものとする。
- 4 コア長は、使用の許可又は不許可を決定したときは、当該者に通知するものとする。

(使用上の支援)

第5条 前条第3項の規定により設備等の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、以下の技術支援をコア長の許可を得て受けることができる。

- 2 分析コアの職員による当該設備等の操作方法の指導等、装置運転に関わる基本的な支援を技術補助と呼ぶ。
- 3 分析コアの職員による電顕試料作製や電顕観察などの実務の代行を技術代行と呼ぶ。
- 4 必要に応じて分析コアの職員から受けるデータの解析・解釈等の使用者の研究内容に関わる支援を解析支援と呼ぶ。必要に応じて高度な技術支援及び学術的知見に基づいた判断を伴う支援を求める場合には、コア長の許可を得なくてはならない。
- 5 使用者が、分析コアの職員に対して共同研究者としての支援及び研究への参画を求める場合には、コア長の許可を得なくてはならない。
- 6 受託研究の一環として技術支援を受ける場合、使用者は事前に研究目的、秘密保持を含む説明を行い、コア長の許可を得なくてはならない。

(目的外使用の禁止)

第6条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に設備等を使用し、又は第三者に使用させてはならない。

(使用の許可の取消し等)

第7条 コア長は、使用者がこの内規に違反し、又は設備等の使用に重大な支障を生じさせたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(利用料及び技術支援料の納付)

第8条 使用責任者は、設備等を使用したとき及び材料分析コアの職員からの支援をうけたときは、所定の手続きにより利用料及び技術支援料を納付しなければならない。

2 前項の利用料及び技術支援料の額は、別に定める。

3 第1項の規定にかかわらず、コア長が特に認めるときは、使用料及び技術支援料の全部または一部を免除することができる。

(免責)

第9条 本所は、設備等の使用によって使用者に生じた損害について、使用者に対し、一切の責任を負わないものとする。

2 技術代行・解析支援において提供する結果およびそれがもたらすいかなる事柄についても、本所及び支援実施者は責任を負わないものとする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失によりその使用に係る設備等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(秘密の保持)

第11条 設備等の使用に当たり、使用者より技術上及び営業上の情報を受け又は知りえた者は、その一切の情報に係る秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。

(知的財産権)

第12条 設備等の使用の結果生じた知的財産権の帰属、取扱い等については、当該発明等の発生事案を勘案して、別途協議して決定するものとする。

(雑則)

第13条 この内規に定めるもののほか設備等の使用に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この内規は、平成28年4月21日から施行する。

附 則 (平成28年10月20日改正)

この内規は、平成28年10月20日から施行し、平成28年10月1日より適用する。

附 則 (平成31年1月17日改正)

この内規は、平成31年1月17日から施行し、平成31年1月1日より適用する。

附 則 (令和2年7月16日改正)

この内規は、令和2年7月1日より施行する。

附 則 (令和2年11月19日改正)

この内規は、令和2年11月19日より施行する。

附 則 (令和3年3月19日改正)

この内規は、令和3年4月1日から施行する。

附 則 (令和3年4月15日改正)

この内規は、令和3年4月15日より施行し、令和3年4月1日より適用する。

附 則（令和4年7月21日改正）

この内規は、令和4年7月21日より施行し、令和4年7月1日より適用する。

附 則（令和5年4月20日改正）

この内規は、令和5年4月20日より施行し、令和5年4月1日より適用する。

別表 分析電子顕微鏡室装置等一覧

装置名	型番/形式
200 kV 収差補正型透過電子顕微鏡 ^(*1)	JEOL JEM-ARM200F
200 kV 分析透過電子顕微鏡	TOPCON EM-002B
200 kV 透過電子顕微鏡	JEOL JEM-2000EX II
200 kV 分析透過電子顕微鏡	JEOL JEM-2100 Plus
電子顕微鏡用 CCD カメラ ^(*2)	Gatan ORIUS 200D (JEOL JEM-2000EX II に附設)
集束イオンビーム加工装置 ^(*1)	FEI Versa 3D LoVac
集束イオンビーム加工装置 ^(*3)	FEI Quanta 3D
イオンスライサ加工装置	JEOL EM-09100IS
イオンミリング加工装置 ^(*2)	Gatan Precision Ion Polishing System (PIPSII)
イオンミリング加工装置 ^(*1)	Gatan Precision Ion Polishing System (PIPSII)
イオンミリング加工装置	FISCHIONE MODEL 1010
オスミウムコータ	NEOC-PRO
X線回折装置 ^(*1)	Rigaku SmartLab 9SW
熱分析装置 ^(*1)	Rigaku Thermo plus EVO II

*1 文科省借受物品、*2 委託管理物品、*3 先端電子顕微鏡センター所属物品